

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
8. April 2004 (08.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/028957 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B81B 7/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2003/000703**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
6. März 2003 (06.03.2003)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
102 44 786.1 26. September 2002 (26.09.2002) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **ROBERT BOSCH GMBH** [DE/DE]; Postfach 30 02  
20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LAMMEL, Gerhard**

[DE/DE]; Gartenstrasse 23, 72074 Tuebingen (DE).  
**ARMBRUSTER, Simon** [DE/DE]; Schafstallstrasse 30,  
72762 Reutlingen (DE). **SCHAEFER, Frank** [DE/DE];  
Otto-Erbe-Weg 52, 72070 Tuebingen (DE). **BENZEL, Hu-**  
**bert** [DE/DE]; Stellenaeckerstrasse 3, 72124 Pliezhausen  
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): **JP, US.**

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

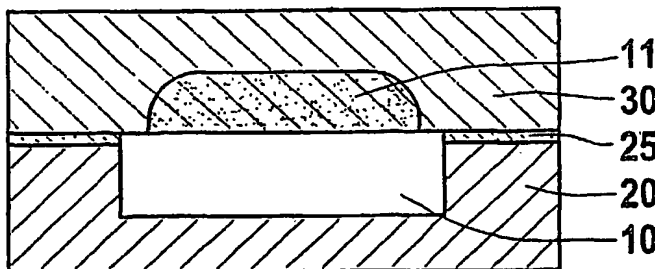
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **MICROMECHANICAL COMPONENT AND METHOD**

(54) Bezeichnung: **MIKROMECHANISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN**



(57) Abstract: Disclosed are a micromechanical  
component and a method for producing a microme-  
chanical component, in which a hollow space (10)  
and an area made of porous silicon (11) are pro-  
vided, said area made of porous silicon (11) being  
used for lowering the pressure in the hollow space  
(10).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein mikro-  
mechanisches Bauelement und ein Verfahren  
zur Herstellung eines mikromechanischen  
Bauelements vorgeschlagen, wobei ein Hohlraum  
(10) und ein Bereich porösen Siliziums (11)  
vorgesehen ist, wobei der Bereich porösen

Siliziums (11) zur Absenkung des Druckes in dem Hohlraum (10) vorgesehen ist.

WO 2004/028957 A1